

低炭素関連装置 運用細目

装置名	極微細表面解析装置（顕微ラマンAFM機能付き）
設置場所	早稲田大学ナノ理工学研究機構 2階201号室
装置管理者	齋藤 美紀子
取扱責任者	齋藤 美紀子

1 パワーユーザの必要要件、権限範囲

- (1) パワーユーザとは、装置の停止、立ち上げ、一般管理（記録、備品準備など）等に関して取扱い責任者と同等の技量を持ち、かつ、精密装置の操作に適した感性、几帳面さを持つ者である。
- (2) パワーユーザは、取扱責任者の講習を受け、合格した者とする。また、定期的な講習を通して、技量の維持向上を図る。
- (3) パワーユーザは、当該装置における現地での簡単なトラブル対応、およびメーカーへのトラブル解決の為の確認の連絡を行う。

2 一般利用者の定義について

- (1) 一般利用者は装置利用前にあらかじめラマン分光評価、レーザー光等基本用語について学習しておくこと。
- (2) 学外からの利用依頼に関する各種事務手続きは、まずナノ理工学研究機構で対応する。

3 利用制限、禁止行為について

- (1) 早稲田大学・理工学部物性計測センター設置の顕微ラマン分光装置（レニショウ、InviaReflex）を用いて実験できるかを最初に調べ、当機器で計測不可能なサンプルのみ当該装置を利用可能とする。
- (2) 顕微鏡試料台の高さ調整は、租調、微調機構となっているが、通常は微調機構のみ利用する。どうしても租調を利用する場合、ロックを外し利用すること。
- (3) レーザー光（波長 532 nm、633 nm、最大出力 75 mW）を用いた装置であるので、直接目に入らないように注意すること。